

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【公表番号】特表2008-503179(P2008-503179A)

【公表日】平成20年1月31日(2008.1.31)

【年通号数】公開・登録公報2008-004

【出願番号】特願2007-527231(P2007-527231)

【国際特許分類】

H 0 1 P 1/397 (2006.01)

H 0 1 P 5/18 (2006.01)

【F I】

H 0 1 P 1/397

H 0 1 P 5/18 G

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月11日(2008.4.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の結合器 (10) と、

平面を規定している第 1 及び第 2 の伝送ライン (8、9) によって前記第 1 の結合器と結合されている第 2 の結合器 (20) と、

第 1 の伝送ライン (8) を横切って形成され、前記平面と実質的に平行であり、その平面内にある第 1 の磁界 (28) と、

第 2 の伝送ライン (9) を横切って形成され、前記平面と実質的に平行であり、その平面内にある第 2 の磁界 (29) とを具備しているサーキュレータ (5)。

【請求項 2】

第 1 の磁界 (28) は、実質的に第 1 の伝送ライン (8) と直交し、第 2 の磁界 (29) は、実質的に第 2 の伝送ライン (9) と直交している請求項 1 記載のサーキュレータ (5)。

【請求項 3】

第 1 及び第 2 の結合器 (10、20) はランゲ結合器である請求項 1 記載のサーキュレータ (5)。

【請求項 4】

第 1 及び第 2 の結合器 (10、20) は基板の表面上に形成されている請求項 1 記載のサーキュレータ (5)。

【請求項 5】

誘電体基板 (7) と、

基板 (7) 上に形成され、第 1 の入力ポート (11) と、第 1 の出力ポート (12) と、第 1 及び第 2 の結合されたポート (13、14) とを有する第 1 のインターデジタルの 4 ポートマイクロストリップ結合器 (10) と、

基板 (7) 上に形成され、第 2 の入力ポート (21) と、第 2 の出力ポート (22) と、第 3 及び第 4 の結合されたポート (24、23) とを有する第 2 のインターデジタルの 4 ポートマイクロストリップ結合器 (20) と、

第 1 の結合されたポート (13) と第 3 の結合されたポート (24) との間に接続されたフェライトで負荷された第 1 の伝送ライン (8) と、

第 2 の結合されたポート (14) と第 4 の結合されたポート (23) との間に接続されたフェライトで負荷された第 2 の伝送ライン (9) と、

基板 (7) に取付けられた第 1 及び第 2 の磁石 (18、19) とを具備し、

前記第 1 の磁石 (18) は第 1 の伝送ライン (8) と交差している第 1 の磁界 (28) を形成し、それは実質的に基板 (7) と平行であり、第 2 の磁石 (19) は第 2 の伝送ライン (9) と交差して第 1 の磁界の極性と反対の極性である第 2 の磁界 (29) を形成し、それは実質的に基板 (7) と平行である低プロファイル構造を有するサーキュレータ (5)。